

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年8月11日 (11.08.2005)

PCT

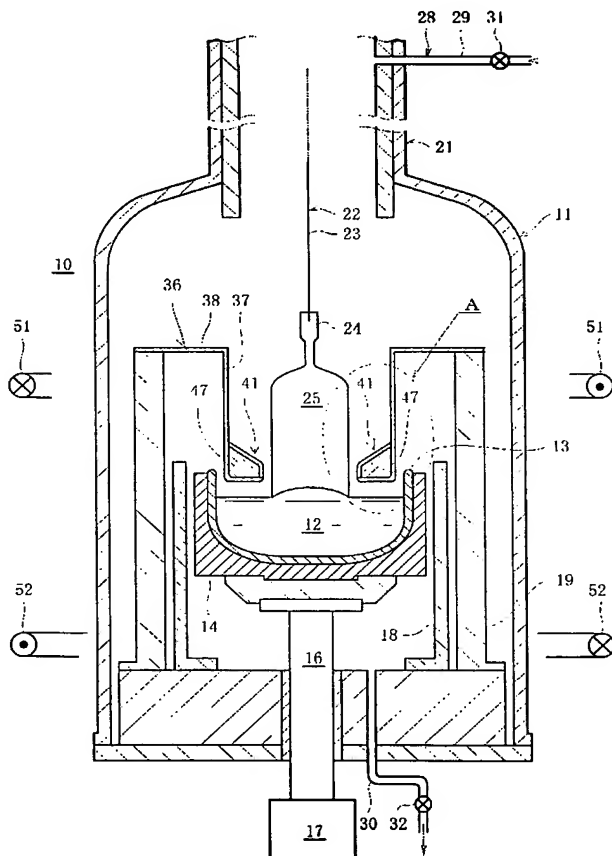
(10) 国際公開番号
WO 2005/073440 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C30B 29/06, 15/00 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000882 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 原田 和浩
(22) 国際出願日: 2005年1月25日 (25.01.2005) (HARADA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区
(25) 国際出願の言語: 日本語 芝浦1丁目2番1号三菱住友シリコン株式会社内
(26) 国際公開の言語: 日本語 Tokyo (JP). 深津 宣人 (FUKATSU, Norihito) [JP/JP]; 〒
1058634 東京都港区芝浦1丁目2番1号三菱住友
(30) 優先権データ: 特願2004-022372 2004年1月30日 (30.01.2004) JP シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 符 森林 (FU, Senlin)
[CN/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦1丁目2番1号
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 洋二
SILICON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058634 東京都 (SUZUKI, Yoji) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦1
港区芝浦1丁目2番1号 Tokyo (JP). 丁目2番1号三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 須田 正義 (SUDA, Masayoshi); 〒1700013 東京
都豊島区東池袋1丁目1番1号日本生命東池袋
ビル Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF LIFTING SILICON SINGLE CRYSTAL

(54) 発明の名称: シリコン単結晶の引上げ方法



(57) Abstract: [PROBLEMS] To produce a silicon single crystal ingot free from point-defect aggregate over almost its entire length without decreasing pure margin. [MEANS OF SOLVING PROBLEMS] A heat shielding member (36) is provided with a bulging unit (41) provided at the lower part of a tube part (37) to swell in the inner side of the tube part and having a heat storing member (47) provided inside thereof. An silicon single crystal ingot (25) is lifted such that the flow rate of an inert gas flowing down between the bulging unit (41) at the heat shielding member (36) and the ingot (25) when a top-side ingot (25a) of the silicon single crystal ingot (25) is lifted is larger than the flow rate of an inert gas flowing down between the bulging unit (41) and the ingot (25) when a bottom-side ingot (25b) of the silicon single crystal ingot (25) is lifted. Alternatively, the intensity of a cusp magnetic field (53) when the top-side ingot (25a) is lifted is set larger than that of the cusp magnetic field (53) when the bottom-side ingot (25b) is lifted.

(57) 要約: 【課題】 ピュアマージンを減少させることなく、ほぼ全長にわたって点欠陥の凝集体が存在しないシリコン単結晶のインゴットを製造する。

【解決手段】 熱遮蔽部材36が、筒部37の下部に筒内の方向に膨出して設けられかつ内部に蓄熱部材47が設けられた膨出部41を備える。シリコン単結晶インゴット25のうちトップ側インゴット25aの引上げ時の熱遮蔽部材36における膨出部41とインゴット25との間を流下する不活性ガスの流量が、シリコン単結晶インゴット25のうちボトム側インゴット25bの引上げ時の膨出部41とインゴット25との間を流下する不活性ガスの流量より多くしてインゴット25を引き上げる。又は、トップ側インゴット25aの引上げ時のカusp磁場53の強度が、ボトム側インゴット25bの引上げ時のカusp磁場53の強度より大きく設定する。



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。